

静電気力を用いた非接触浮上装置

高知工科大学知能機械システム工学科

田中 智大

1. 緒言

1.1 要旨

現在あらゆるところで使用されている機械的な支持機構は、一般的に支持する対象物と直接接触して、その動きを制御するものが主流である。このような支持機構の場合、そこには必ず摩擦が発生し塵埃発生の原因となる。このためクリーン度が要求されるとき、支持機構は非接触のものが望まれる。

本研究では、こういった場合が想定される半導体工場でのシリコンウエハの能動的な制御を、静電気力を用いた非接触浮上装置で考える。